個人簡歷表



江文煌

個人資料 PERSONAL

生 日: 1972/11/20

財金碩(二)

研究方向

趣

創新管理與數位經營、 春業競爭分析、財務等

產業競爭分析、財務管

聯繫方式 CONTACT INFO

TEL: 0955-575333

Email: whijiang@ms4. hinet. net

工作經歷

2006.10-迄今

宸韓科技 董事長兼總經理

允天科技 總經理

艾里斯特 董事長兼總經理

蘇州飛立沛 總經理 威騰國際 總經理

擬訂公司長短期策略規劃及年度經營計畫並對公司重大投資、經營活動領導正確決策。建立、規劃及審核公司組織體系之各項管理制度與公司人才開發及教育訓練課程。督警各部主管推動既定策略及經營目標、定期召開經營會議並落實、考核和協調各部門的工作進展並以先進工程技術開發、危機處理及風險控制及業績目標設定建工作中塑造公司組織包裝管要。主持公司的日常經營管理工作中塑造公司組織司營管要。主持公司的日常經營管理工作中塑造方向與公司經營管理目標方向一致,並針對當前市場景氣形態調整行銷策略及作法、策動所有人員達成目標以實現公司經營管理和發展目標。

1994.05-2012.01

台灣積體電路(TSMC) 副理

PM Leader, FAC Gas System Sponsor, Group Leader, Team Leader in areas of F8A Implant, F8A PVD, F8 Sputter, F8 FAC, F8 TFE



證書與榮譽

1994 - 迄今

專利證書

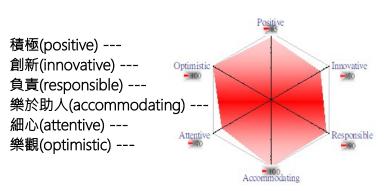
證書名稱₽	發明名稱₽	發明人₽
中華明民國專利證書	製程設備測漏氣的方法。	賴東隆、江文煌、陳建慶
發明第 084434 號₽		20 300 90 700 800 90 100 300 300 300 300 300 300 300 300 30

著作案例

1. The Investigation of Ti-silicide Non-uniform Formation Defect

2. The Particle Source Analysis and Trace Method for CVD-TiN Chambers

Personal Characteristic



得獎榮譽

榮譽/獎勵 單位↩	榮譽 / 獎勵 名稱。	
	TQE 獎:↔	
台灣積體電路(股)公司₽	A NEW DEVELOPMENT INTERLOCK KIT FOR DETECTING $\!$	
2000 000000000 - 2019000 - 204000 - 20400	MDX SERIES SLAVE DC POWER SUPPLY FAILURE.	
	TQE 獎: ↵	
台灣積體電路(股)公司₽	LEAK DEITECT ON METHHODOLOGY FOR RTA SYSTEM	
	WITH OXYGEN OR HUMIDITY ANALYZER.₽	
APPLIED MATERIALS	ENDURA HP PVD ADVANCED CALIBRATION PROCEDURES.	
APPLIED MATERIALS	ENDURA HP PVD FUNCEIONAL DESCRIPTION AND BASIC PREVENTATIVE MAINTENANCE.	